PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-104960

(43)Date of publication of application: 17.04.2001

(51)Int.CI.

C02F 1/469 B01D 61/48 C02F 1/42

(21)Application number: 11-287044

(71)Applicant: KURITA WATER IND LTD

(22)Date of filing:

07.10.1999

(72)Inventor: IWASAKI KUNIHIRO

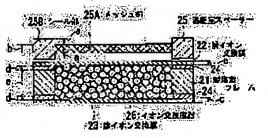
(54) ELECTRIC DEIONIZING APPARATUS

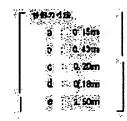
(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To stably and certainly obtain treated water of high quality by improving the packed state of an ion exchanger in the desalting chamber of an electric deionizing apparatus.

SOLUTION: The desalting chamber of an electric

deionizing apparatus is packed with an ion exchanger so that the volume of the ion exchanger at a time of the passage of water becomes 101-120% of the volume the desalting chamber.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

28.09.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出慮公開發号 特開2001-104960

(P2001 - 104960A)

(43)公顷日 平成13年4月17日(2001.4.17)

(51) Int.CL'	織別配号	FΙ	ラーマコード(参考)
C02F 1/469		BO1D 61/48	4D006
B01D 61/48		C 0 2 F 1/42	ZABA 4D025
C 0 2 F 1/42	ZAB	1/46	103 4D061

密査請求 京請求 第求項の数2 OL (全 5 页)

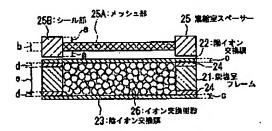
		1
(21)出翩串号	物顧平11-287044	(71)出頃人 000001063
		采田工業株式会社
(22)出題日	平成11年10月7日(1999.10.7)	京京都新宿区西新宿3丁目4番7号
		(72) 発明者 岩崎 邦牌
		東京都新宿区西新宿三丁目4番7号 聚田
·		工業旅式会社内
		(74)代理人 100098911
		非理土 邕財 剛
		Pターム(参考) 4D008 GAIT HAAT KA28 WAG3 MA13
		MAL4 PAOL PB23 PC03
		40025 AAG2 ABO2 BAO8 BA13 BA22
	•	BA25 DA05 DA08
		4D061 DA01 D313 EA09 EB04 EB13
		EB18 FA08 GC20

(54) 【発明の名称】 電気脱イオン装留

(57)【要約】

【課題】 電気脱イオン装置の脱塩室におけるイオン交 後体の充填状態を改善することにより、高水質の処理水 を安定かつ確実に得る。

【解決手段】 イオン交換体の通水時容積が脱塩室容積 の101~120%となるように、電気脱イオン鉄置の 脱塩室にイオン交換体を充填する。





d : Of 18mm

(2)

【特許請求の範囲】

【註求項 】】 除極を備えてなる陰極室と隔極を備えて なる陽径室との間に陰イオン交換膜と陽イオン交換膜と を交互に配列して脱塩室と追縮室とを形成し、酸脱塩室 にイオン交換体を充填した電気脱イオン装置において、 該イオン交換体の通水時容積が該脱塩室容積の101~ 120%であることを特徴とする電気脱イオン装置。 【詰求項2】 詰求項1において、該緊塩室に充填され るイオン交換体の乾燥時容積が該脱塩室の容積の80~ 95%であることを特徴とする電気脱イオン装置。 【発明の詳細な説明】

1

[0001]

【発明の届する技術分野】本発明は、陰極と陽極との間 に、複数のアニオン交換膜とカチオン交換膜とを交互に 配列して濃縮室と脱塩室とを交互に形成してなる電気脱 イオン装置(電気再生式脱イオン装置)に係り、特に、 この電気脱イオン装置の脱塩室に充填するイオン交換体 の充填密度を改善して、得られる脱イオン水の水質を高 めた電気脱イオン装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、半導体製造工場、液晶製造工場、 製薬工業、食品工業、電力工業等の各種の産業ないし研 究施設等において使用される脱イオン水の製造には、イ オン交換制脂のような再生を必要とせず、完全な連続採 水が可能で、極めて高純度の水を効率的に得ることがで きるという優れた特長を備えることから、電気脱イオン 装置が多用されている。

【0003】電気脱イオン装置は、電便同士の間に複数 のカチオン交換膜とアニオン交換膜とを交互に配列して 体を充填した構成を有する。この電気脱イオン装置にあ っては陽極、陰極間に電圧を印加しながら脱塩室に彼処 **理水を流入させると共に、造縮室に造稿水を流入させ彼** 処理水中の不純物イオンを除去し、脱イオン水を製造す

【①①①4】図2はこの電気脱イオン装置の基本的な機 成を示す分解図である。

【0005】陰極側のエンドプレート1に沿って陰極電 極飯2が配置され、この陰極電極板2の国縁部に枠状の 陰極用スペーサー3が重ね合わされる。この陰極用スペ 40 の安定性の面で問題があった。 ーサー3の上にカチオン交換膜4、脱塩度形成用の枠状 フレーム5、アニオン交換膜6及び遺稿室形成用の枠状 フレーム7がこの順に重ね合わされる。このカチオン交 換職4、脱塩室形成用の枠状プレーム5、アニオン交換 順6及び濃縮室形成用の枠状フレーム?が1単位として 多数重ね合わされる。即ち、膜4、フレーム5、膜6、 フレーム7が連続して繰り返し積層される。最後のアニ オン交換膜6に対し枠状の陽極用スペーサー8を介して 院師電極板9が重ね合わされ、その上に院極側エンドブ

体はボルト等によって締め付けられる。

【0006】上記の脱塩室用フレーム5の内側スペース が脱塩室となっており、この脱塩室にはイオン交換制脂 等のイオン交換体5 Rが充填される。また、濃縮室用フ レーム7の内側スペースが濃縮室となっている。この濃 縮室にはメッシュスペーサー7 Mなどが配置される。

【0007】このような装置にあっては、陽極9と陰極 2の間に直流電流を通じ、且つ彼処理水(原水)を彼処 翅水流入ライン11を通して脱塩室内に通水せしめ、ま 19 た、遺縮水を遺稿水流入ライン12を通じて濃縮室内に 通水ゼレめる。民塩室内に流入してきた彼処理水はイオ ン交換衛脂の充填層を施下し、その際、該被処理水中の 不純物イオンが除かれて脱イオン水となり、これが脱イ オン水流出ライン13を経て流出する。

【①①08】一方、濃縮室内に通水された濃縮水は濃縮 室内を流下するときに、イオン交換膜4,6を介して移 動してくる不純物イオンを受け取り、不純物イオンを濃 縮した濃縮水として濃縮水流出ライン14より流出す る。電極室にはそれぞれ導入ライン15、16及び取出 20 ライン17.18を介して電極水が流通される。

【0009】特開平10-216729号公銀には、こ のような電気脱イオン装置において、電気抵抗を小さく して処理の安定化を図るべく、脱塩室内に充填したイオ ン交換体とイオン交換膜との間に0.1~20kg/c m¹ の圧力を発生させて、イオン交換体相互及びイオン 交換体とイオン交換膜との密着性を上げることが記載さ れている。そして、同公報には脱俎室に充填するイオン 交換体を再生型の容論より容韻を減少させた形に変換 し、自由状態でのイオン交換体再生型容績が脱塩室容績 脱塩室と濃縮室とを交互に形成し、脱塩室にイオン交換 30 に対して103%~170%となる量のイオン交換体を 充填することが記載されている。ただし、同公報では、 通水時(使用状態)におけるイオン交換体の容積につい。 ては検討されていない。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】しかし、特闘平10-216729号公報に記載されるように、自由状態での イオン交換体再生型容績が脱塩室容績に対して103~ 170%となるようにイオン交換体を充填しても、必ず しも良好な水質の処理水が得られるわけではなく、処理

【①①11】本発明は上記従来の問題点を解決し、電気 脱イオン装置の脱塩室におけるイオン交換体の充填状態 を改善することにより、高水質の処理水を安定かつ確実 に得ることができるようにした電気脱イオン装置を提供 することを目的とする。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明の電気脱イオン袋 置は、陰極を備えてなる陰極室と陽極を備えてなる陽極 室との間に、除イオン交換機と隔イオン交換膜とを交互 レート10が重ね合わされて荷屋体とされる。この荷屋 50 に配列して脱塩富と濃縮富とを形成し、鉄脱塩富にイオ

ン交換体を充填した電気脱イオン整置において、酸イオ ン交換体の通水時容積が該脳塩室容積の101~120 %であることを特徴とする。

【0013】なお、以下において、脱塩室に充填された イオン交換体の道水時の容積(このイオン交換体の容積 は、 道水時の脱塩室の容積に相当する。)の、 脱塩室容 續(この脱塩室容績とは、イオン交換体を充填する前の 脱塩室の容韻である。) に対する割合 (百分率) を「通 水時容積率」と称す場合がある。

と、イオン交換体同士及びイオン交換体とイオン交換膜 との接点数が増え、脱塩室内でのイオンの移動が容易に なり、処理水の比抵抗が向上する。また、このようにイ オン交換体の充填密度を高めると、遺稿室もスペーサー を介して脱塩室のイオン交換体の影瀾により圧縮される ことにより、脱塩室から濃縮室へのイオンの移動が速く なり、脱塩が円滑に進行し、このことによっても、処理 水の比抵抗が向上する。

【0015】しかし、特願平10-216729号公報 3~170%のイオン交換体を充填すると過充填となっ て脱塩室の圧力損失が増え、処理水量が低下する上に、 濃縮室スペーサーのシールが不十分となる問題があり、 処理水の比抵抗が低下する場合がある。

【0016】本発明では、通水時容積率が101~12 ()%となるように脱塩室にイオン交換体を充填するた め、比抵抗18MQ・cm以上の処理水を安定かつ確実 に得ることができる。

【りり17】とのような本発明の電気脱イオン装置は、 吸水により膨潤すると乾燥時の110~130%程度に 30 容積が大きくなるようなイオン交換体を用い、このイオ ン交換体を乾燥状態で、脱塩室の容積に対して80~9 5%(以下、この割合を「乾燥充填率」と称す場合があ る。)となるように、脱塩室に充填して通水時容積率が 101~120%、好ましくは110%程度となるよう にして作製するのが好ましい。

[0018]

【発明の真施の形態】以下に本発明の実施の形態を詳細 に説明する。

【1)019】本発明の電気脱イオン装置は、通水時容積 40 字が101~120%となるように脱塩室にイオン交換 体を充填すること以外は、図2に示す一般的な電気脱イ オン装置と同様の構成とされている。

【0020】との通水時容積率が101%未満では、イ オン交換体の充填置が不足して十分に比抵抗の高い処理 水を得ることができない。 通水時容積率が120%を超 えるとイオン交換体の充填量が多過ぎて、濃縮室スペー サーのシールが不十分となり、やはり処理水の比抵抗が 低下する。従って、通水時容荷率は101~120%、

うに充填するのが好ましい。

【0021】とのような電気脱イオン鉄置を作製するに は、吸水により膨靭すると乾燥時の110~130%程 度に容積が大きくなるようなイオン交換体を用い、この イオン交換体を脱塩室に乾燥充填率80~95%となる ように充填し、道水時の膨潤状態において通水時容論率 が101~120%となるようにするのが好ましい。

【0022】このような充填率で脱塩室にイオン交換体 を充填すると、電気脱イオン装置の道水使用時にはイオ 【0014】脱塩室のイオン交換体の充填密度を高める 15 ン交換体の吸水による膨潤で脱塩室を仕切るイオン交換 膜は遺縮室側に膨らんで、脱塩室はイオン交換体充填前 の厚みよりも厚みが増すことになるが、この厚みの増加 置は、各々濃縮室側に0.1~1.0mm、台計で0. 2~2. () mm程度であることが好ましい。

【0023】なお、脱塩室に充填するイオン交換体とし ては、イオン交換樹脂、イオン交換機能等を用いること ができ、その充填方法には特に制限はなく、富法に従っ て行うことができる。例えば、イオン交換樹脂をメタノ ール洗浄し、真空乾燥機にかけて乾燥後、乾燥樹脂を脱 に記載されるように自由状態で脱塩室容誦に対して10 20 塩室に収納して電気脱イオン装置を組み立て、その後通 水して制脂に水分を吸収させて膨調させる方法を採用す ることができる。

[0024]

【実施例】以下に実施例及び比較例を挙げて本発明をよ り具体的に説明する。

【0025】実能例1

イオン交換御脂として、ダウケミカル社製モノスフィア (650C、550A) を用い、陽イオン交換樹脂/陰 イオン交換衛脂=40/60 (湿潤状態での容債比)で 混合したものを、まず、10%食塩水に浸漬して塩型に 変換した後、メタノールに浸漬して水分を溶媒置換し、 これを真空乾燥機に入れて約1.5torrで2~3時 間乾燥後、デンケーター中に保管した。

【0026】との乾燥樹脂は吸水により膨調して乾燥時 の容積に比べて129%となるものである。この樹脂を 用いて図1に示す寸法の緊塩室及び遺稿室を有する電気 脱イオン装置を製作した。

【0027】電気脱イオン装置の組み立てに当っては、 まず、脱塩室フレーム21の両側に両面テープ24を貼 り、陽イオン交換膜22を貼り、次に乾燥状態のイオン 交換樹脂26を充填し、次に陰イオン交換膜23を貼っ て脱塩室の機成単位を作製した。この脱塩室の構成単位 3枚と濃縮室スペーサー25 (シール部25Bに取り付 けられたメッシュ部25Aは20メッシュ)2枚を交互 に重ねて150kgf·cmのトルクで締め付けて電気 脱イオン装置を作製し、脱塩室及び遺稿室に導電率8 μ s/cmの水を10分間供給してイオン交換樹脂を十分 に湿潤化させて膨靭させた。

【0028】各部材の寸法は図1に示す通りであり、脱 特に105~115%、とりわけ110%程度となるよ 50 塩室の容荷は665mm×(2.5+0.18+0.1

8) mm×28mm×4リブ=213ccである。 【0029】との脱塩室に乾燥したイオン交換樹脂を1 92cc充填した。従って、乾燥充填率は90%(=1 92÷213×100)である。

【0030】脱塩室は通水時においては、樹脂の影響で両側の濃縮室側へイオン交換膜が膨らんで厚みが増える。この通水時のイオン交換体の容積に相当する通水時の脱塩室の容債を調べるために、電気脱イオン装置の通水後の解体の際に、樹脂を取り出す前に両側のイオン交換機が膨らんでいる状態で脱塩室厚さ(両側のイオン交換機を含む)をノギスで実測し、脱塩室の厚さをノギスの実測値から両イオン交換機の厚さを差し引いて求めた。その結果、イオン交換機にはシワがよっている部分もあったが、ノギスの実測値は平均で3.6mmであり、脱塩室の厚さは3.2mm(3.6-(0.2+0.2))であるとされた。従って、適水時の脱塩室の*

* 容積は、238 c c (=665 mm×3.2 mm×28 mm×4 リブ) であると考えられる。

【0031】従って、通水時容積率は112%(=238÷213×100)である。

【0032】との電気脱イオン装置に導電率8μs/cm. シリカ284ppb. pH7の水を電圧8. 4V, 電流0. 45Aの条件で道水して脱塩処理を行った。

【0033】 このときの処理水質及び脱塩室の圧力損失 と、得られた処理水の水質は衰1に示す通りであった。 【0034】実起例2、3、比較例1、2

乾燥充填率を変え、通水時容積率を表1に示す値とした こと以外は衰越例1と同様にして電気脱イオン装置を組 み立て、同様に脱塩処理を行って、得られた処理水の水 質を表1に示した。

[0035]

【表1】

		通水時 容積率 (%)	処理水型 (L/hr)	税塩室の 圧力損失 (kg/cm*)	処理水水質	
8	5]				比据统 (MQ·cm)	シリカ (rpb)※
	1	112	40	0. 4	17. 93	6 (97. 9)
实施例	2	105	40	0. 4	17. 20	6 (97. 9)
	3	115	40	Q. 35	17. 77	6 (97. 9)
比较例	1	100	40	G. 45	15	13 (95. 4)
	2	130	40	0. 6	5	45

※カッコ内はシリカ除去率(%)

[0036]

【発明の効果】以上詳述した通り、本発明の電気脱イオン装置によれば、著しく高純度の処理水を安定かつ確実 30 に製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例で製作した電気脱イオン装置の脱塩室と 濃縮室を示す断面図である。

【図2】電気脱イオン装置の一般的な構成を示す分解料 視図である。

【符号の説明】

4 カチオン交換膜

5 フレーム

5 R イオン交換体 6 アニオン交換膜

7 フレーム

7M メッシュスペーサ

21 脱塩室フレーム

22 陽イオン交換膜

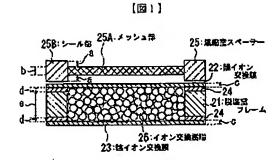
23 陰イオン交換膜

24 両面テープ

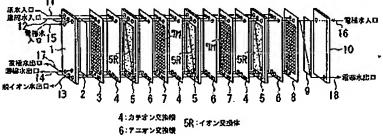
25 濃縮空スペーサー

26 イオン交換制脂

(5)



名 · 0.15mm b : 0.40mm c : 0.20mm d : 0£18mm e : 2.50mm



[図2]